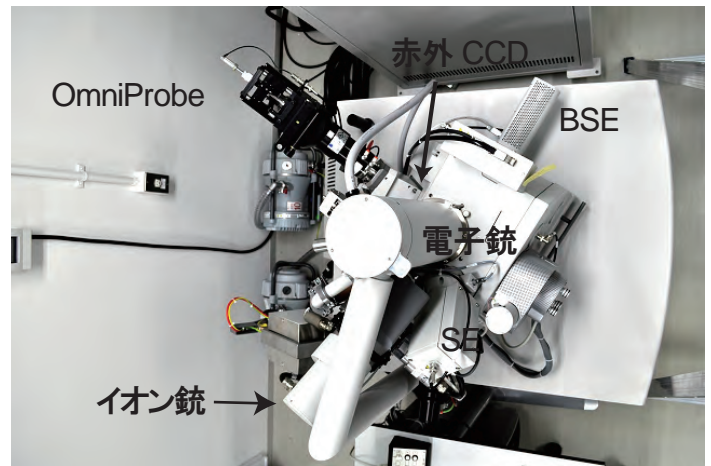


# Quanta 200 3DS

販売元: 株式会社 島津製作所    製造元: FEI COMPANY



カタログスペック表

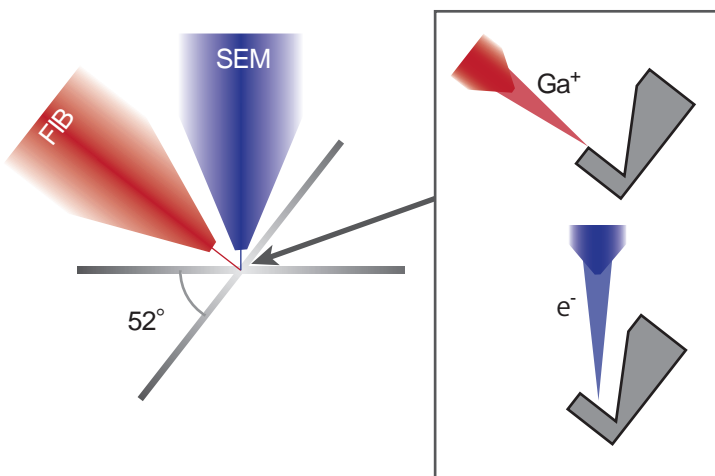
SEM (W)	分解能	高真空	3.0nm 30kV (SE)
		低真空	3.0nm 30kV (SE)
		ESEM	3.0nm 30kV (SE)
	試料室真空度	高真空	6x10 <sup>-4</sup> Pa
		低真空	10-130Pa
加速電圧		200V-30kV	

FIB (液体金属 Ga)	分解能	高真空	9.0nm 30kV
	加速電圧	2kV-30kV	
	プローブ電流	1pA-65nA (15ステップ)	
	ソース寿命	1000h	

ステージ	X-Y	50mm x 50mm
	傾斜	-10 - +60°
	Z	25mm
	回転	360° 回転

その他

- ・試料室内ピックアップシステム (OmniProbe 100.7)
- ・Pt デポジション (有機白金)
- ・半導体反射電子検出器
- ・Si(Li)-EDS 検出器 (EDAX 社製 Genesis)
- ・赤外 CCD カメラ
- ・真空系: スクロールポンプ  
ターボ分子ポンプ  
イオンポンプ (イオン銃のみ)



連絡先: miya @ kueps.kyoto-u.ac.jp

TEM 試料作製手順

